

a 2000 0083

Invenția se referă la aparate sensibile la gaze, în special la senzori de gaze toxice pe bază de semiconductori.

Esența invenției constă în aceea că senzorul de gaze toxice pe baza peliculelor subțiri de semiconductori conține un substrat izolator pe care este depus un strat sensibil la gaze din semiconductor calcogenic ce conține telur sau aliajele lui. Pe stratul sensibil sunt depuși doi electrozi metalici, situați longitudinal sau transversal.

Rezultatul invenției constă în realizarea unui senzor cu viteză de reacție ce funcționează la temperatura camerei.